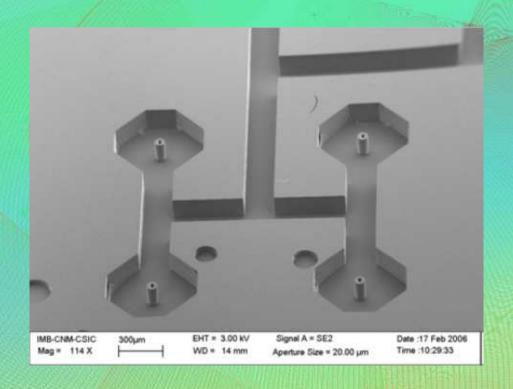
Microfluídica



José Manuel Quero Reboul Dpto. Ingeniería Electrónica Universidad de Sevilla

Indice

- · Motivación.
- Comportamiento de los fluidos a microescala.
- Ejemplos:
 - Lab-on-Chip.
 - Nebulizador.
- Proceso de fabricación.
- Caso práctico: caudalímetro.
- Resumen.

Motivación

Definición:

Tecnología de fabricación multidisciplinar (física, química, biología, ingeniería) que manipula fluidos à escala micrométrica.

Fabricación de dispositivos que manejan fluidos a escalas micrométricas:

- Inyectores.
- Nébulizadores.
- Lab on a Chip (LoC) o Total Analisys System (uTAS).
- Micropropulsores.Pilas de combustible.

Casos de éxito:

- Cabezal de inyección de tinta.
- Chips ADN.

Motivación

Ventajas competitivas:

- Coste producción.
- Repetitividad.
- Precisión.
- Pequeños volúmenes de muestras y reactivos
- Mayor velocidad de reacción y análisis
- Mejor control de procesos.
- Paralelización (fábricas del futuro)
- Seguridad (contaminación química, biológica, radioactiva...)
- Bajo consumo.

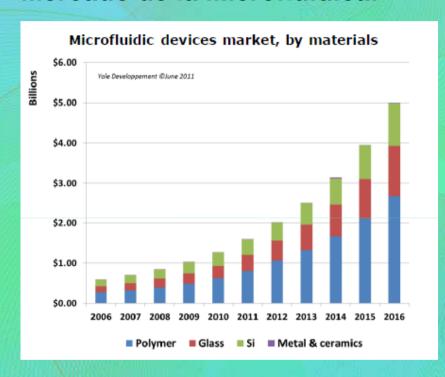
Inconvenientes:

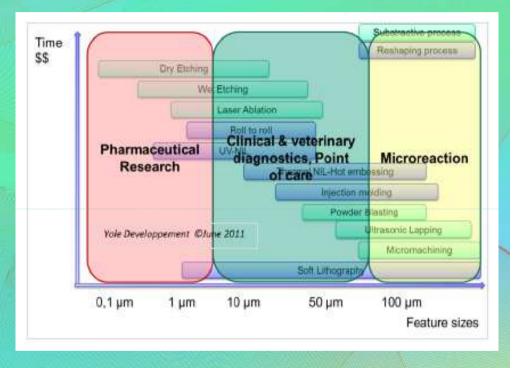
- Tecnologías poco desarrolladas
- Efectos de escala adversos.
- Elevada razón señal/ruido en los detectores al escalarlos.
- Relativa baja precisión de las geometrías a microescala

FABRICACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS

Motivación

Mercado de la Microfluídica:





Mercado por tecnologías

Elección del proceso óptimo

Indice

- Motivación.
- Comportamiento de los fluidos a microescala.
- Ejemplos:
 - Lab-on-Chip.
 - Nebulizador.
- Proceso de fabricación.
- Caso práctico: caudalímetro.
- Resumen.

Ecuaciones de Navier-Stokes:

Leyes de conservación de:

$$S/MU(\rho v) = 0$$

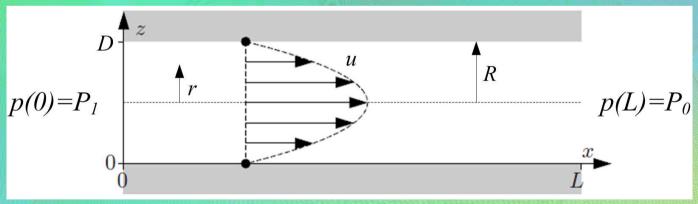
$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla v \right) V V V \tau + \rho \vec{f}_{m}$$

Números adimensionales:

Reynolds: Fuerzas inerciales/viscosas

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu} \propto L^2$$

Si Re<2000 dominado viscosas



Flujo laminar

Números adimensionales:

Péclet: Transporte por convección/difusión

$$Pe = \frac{vL}{D} \propto L^2$$

D = Difusividad

Si Pe próximo a 1, domina la difusión:

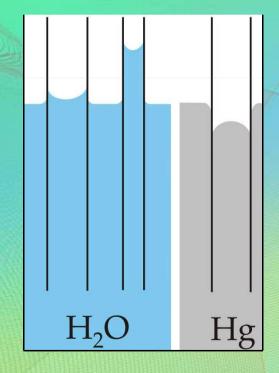
En un conducto con flujo laminar, en dirección de conducto se produce convección, en dirección perpendicular se produce difusión.

Números adimensionales:

Capilaridad: Fuerzas viscosas/ tensión superficial

$$Ca = \frac{\mu v}{\sigma} \propto L$$

Si Ca<10⁻⁵ dominado por capilaridad



Números adimensionales:

Weber: Fuerzas inerciales/tensión superficial

$$We = \frac{\rho v^2 L}{\sigma} \propto L$$

Importante para la atomización: cuanto mayor Weber menor tamaño de gota.

Leves de Escala:

	Magnitudes y fuerzas	Ley de
	físicas	escala
	Masa	L^3
	Volumen	\mathbb{L}^3
	Gravedad	L^3
\longrightarrow	Tensión superficial	L^1
	Fuerza electrostática	L^2
	Fuerza elástica	L^2
	Fuerza magnética	$L^{3} / L^{4} $ (*)
\longrightarrow	Fricción viscosa	L^1
	Velocidad de flujo	L^1
\longrightarrow	Tiempo de difusión	L^2

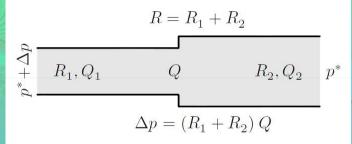
^(*) Esta fuerza depende de si existe un campo exterior o no, siendo L³ y L⁴

Modelos eléctricos equivalentes:

Resistencia fluídica: Ley de Hagen-Poiseuille

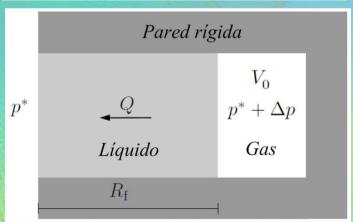
$$\Delta P = R_f Q$$

con
$$R_f = \frac{128\mu L}{\pi D^4}$$
 para conducto circular.



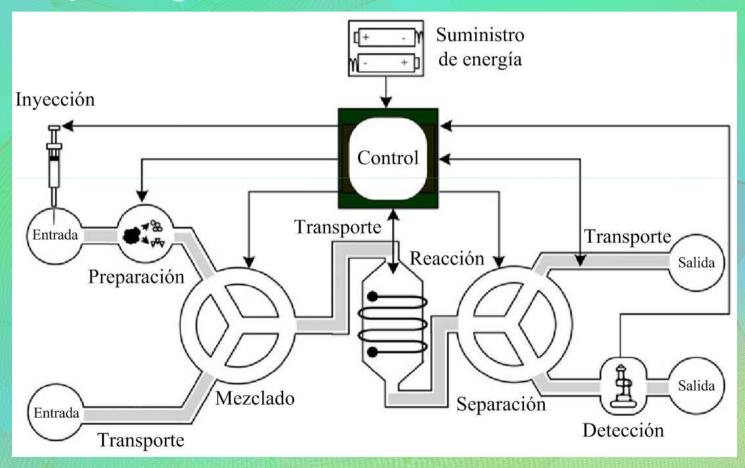
Capacidad fluídica:

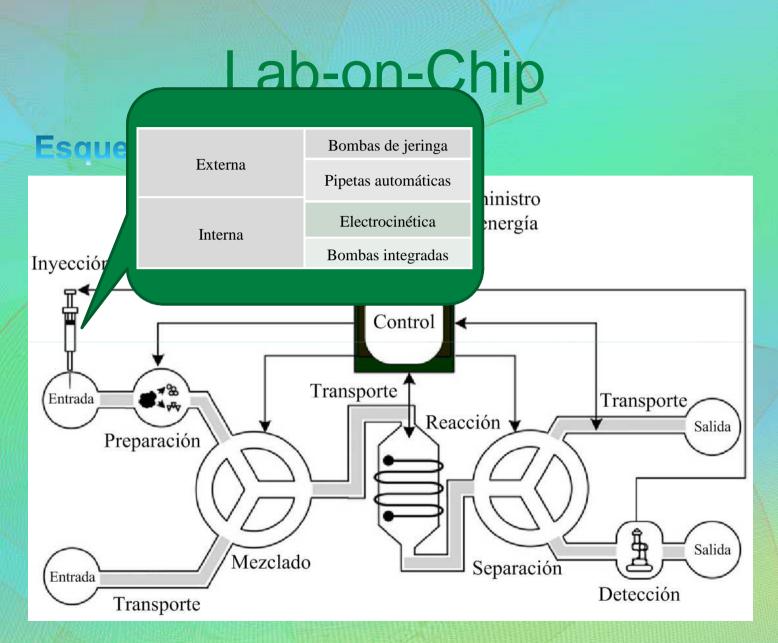
$$\Delta P = \frac{V}{C_f}$$
 con
$$C_f = \frac{V_0}{P_0}$$

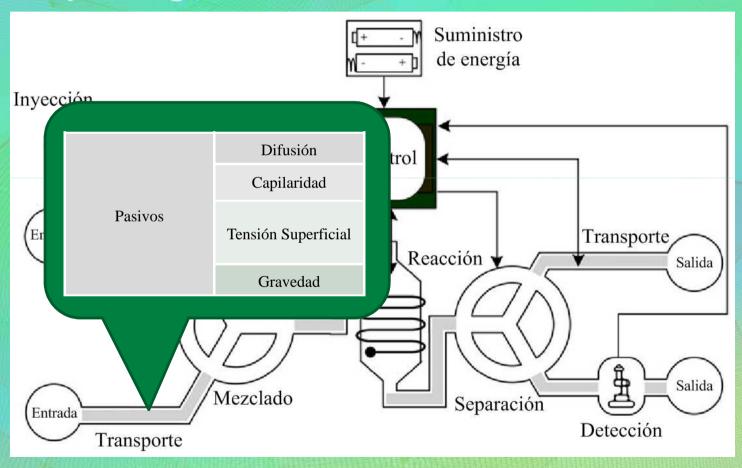


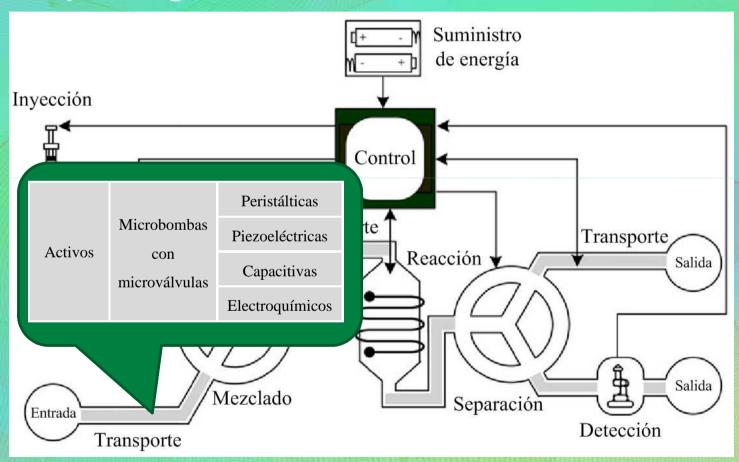
Indice

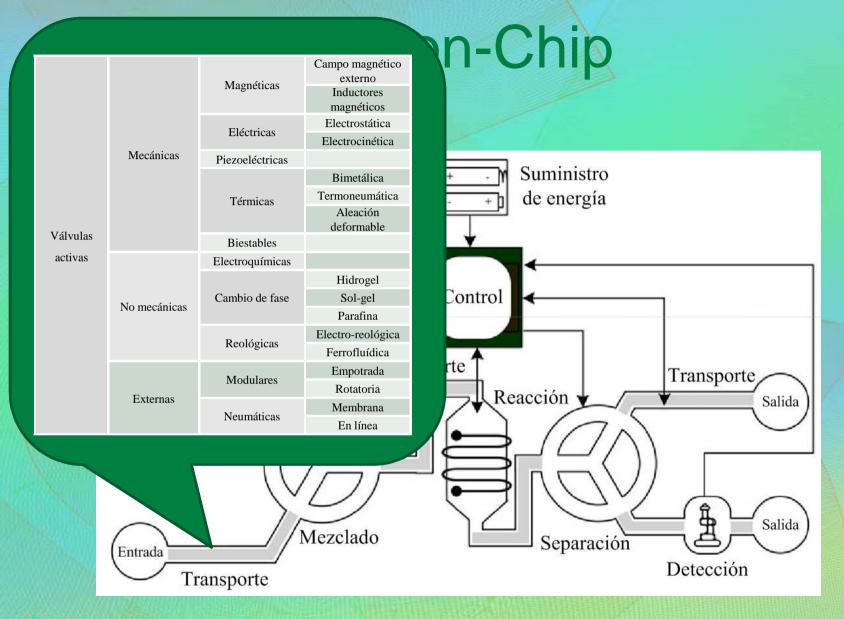
- · Motivación.
- Comportamiento de los fluidos a microescala.
- Ejemplos:
 - Lab-on-Chip.
 - Nebulizador.
- Proceso de fabricación.
- Caso práctico: caudalímetro.
- Resumen.

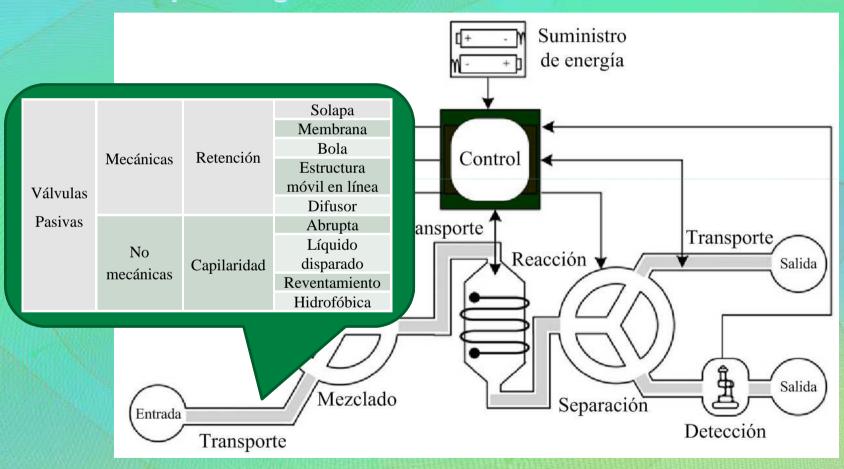


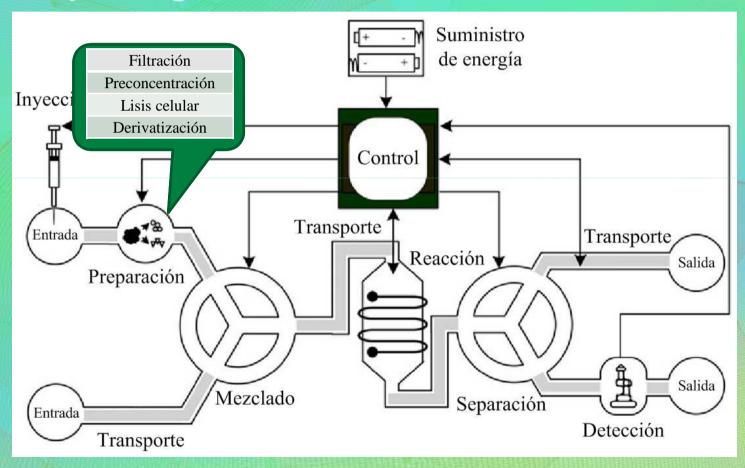


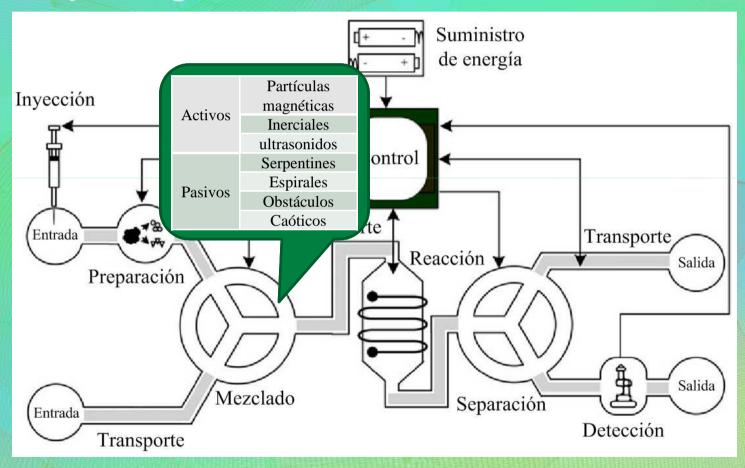


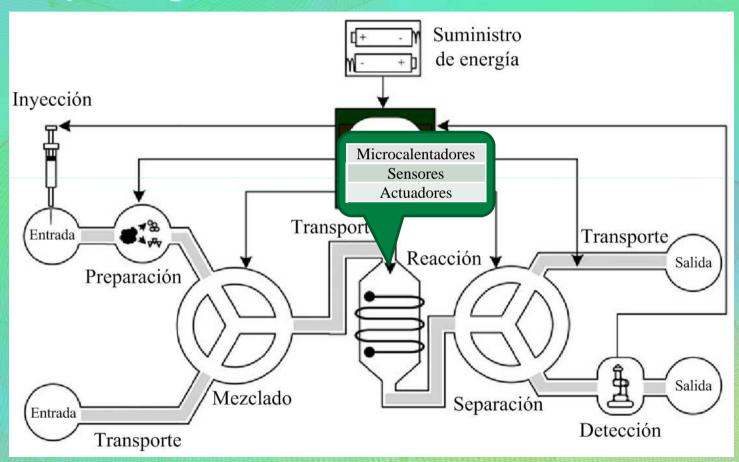


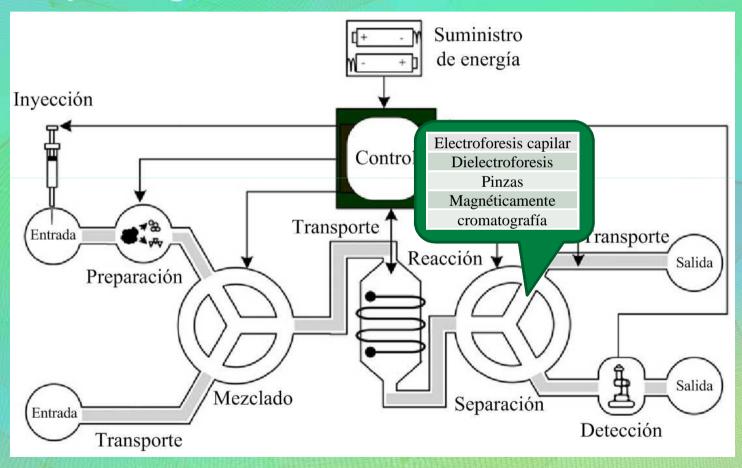


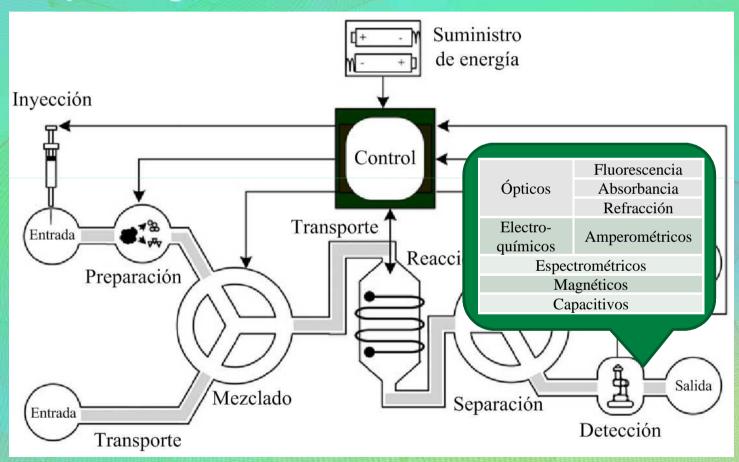




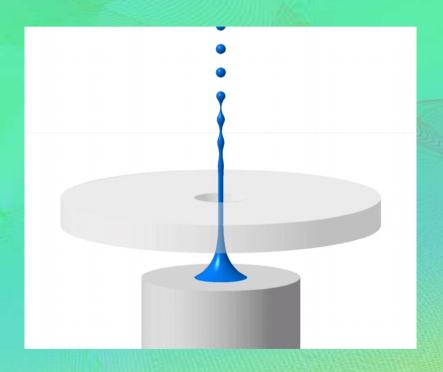








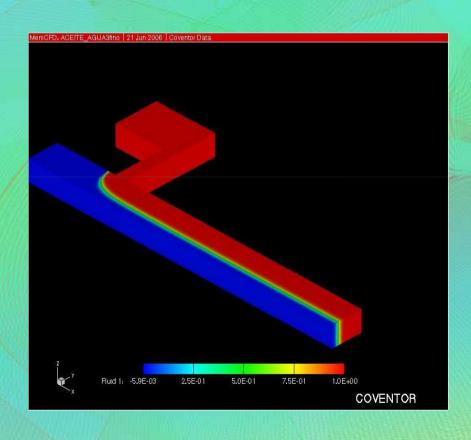
Esquema general Flow Focussing:



Junio 2011

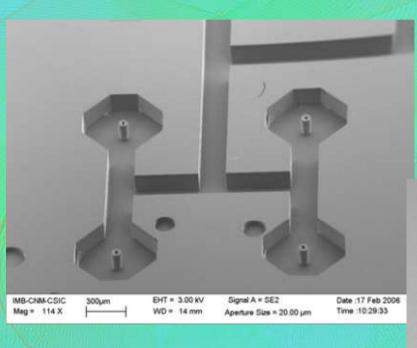
Escuela de Verano IBERNAM

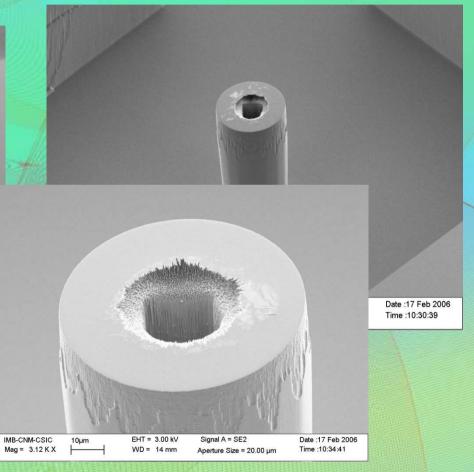
Simulación en Coventor:



- Microemulsión.
- Agua-aceite.
- Modelo axilsimétrico.

Fabricación en silicio (CNM):

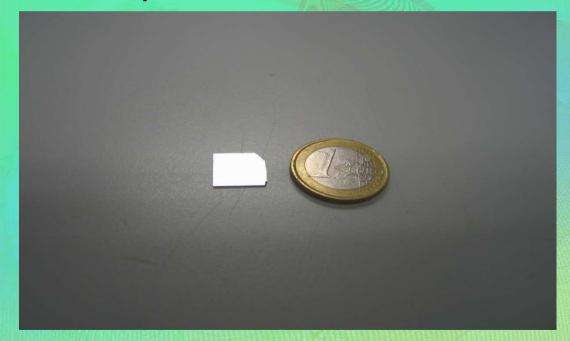




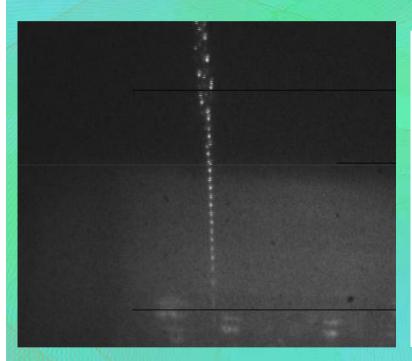
Fabricación en silicio (CNM):

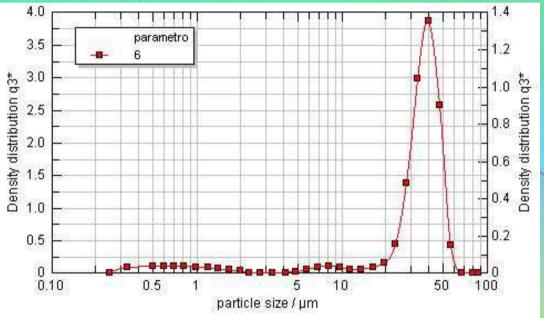
Chip Flow focusing

- Tamaño total (12 x 12x 1.04 mm), con 64 salidas
- Diámetro salidas = 50 μm



Caracterización:





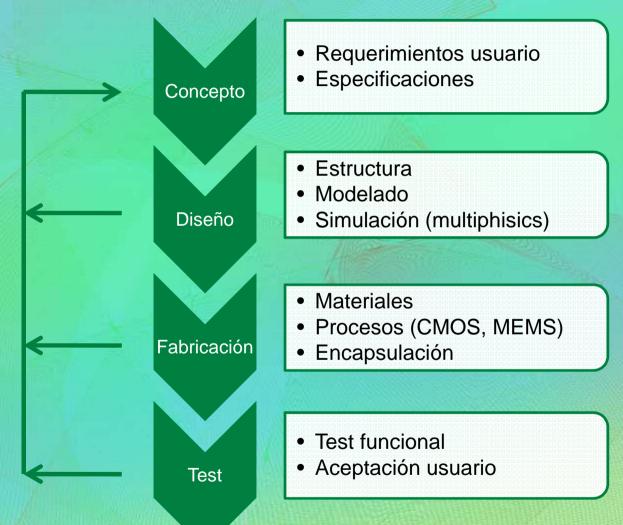
Generación de microburbujas

Monodispersión

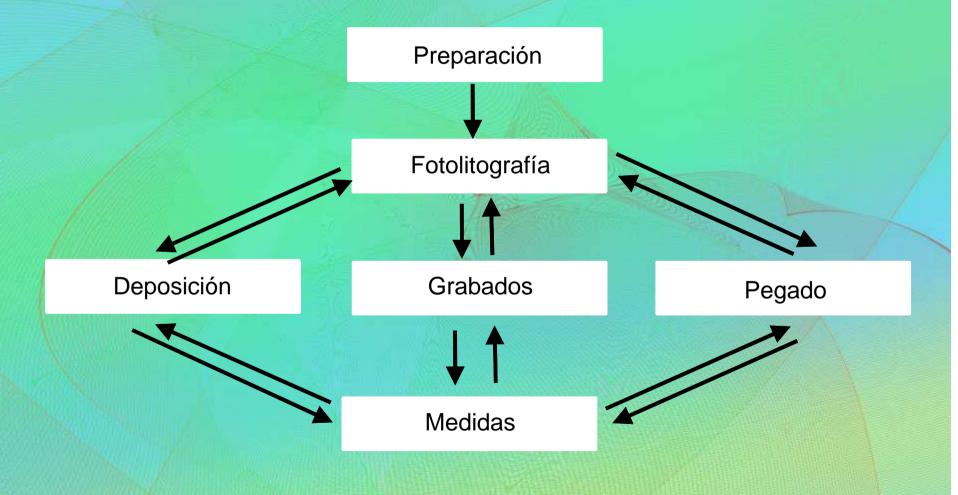
Indice

- Motivación.
- Comportamiento de los fluidos a microescala.
- Ejemplos:
 - Lab-on-Chip.
 - Nebulizador.
- Proceso de fabricación.
- Caso práctico: caudalímetro.
- Resumen.

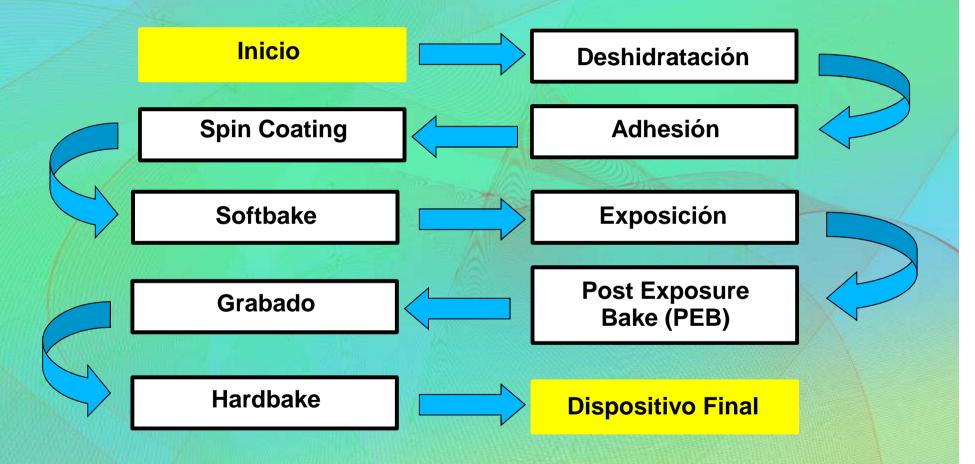
Procesos







Proceso con SU8



Caso Práctico

Caudalimetro. Concepto:

Objetivo:

Caudalímetro para medir flujo de líquidos en el rango de decenas de microlitros.

Criterios de diseño:

- Máximo rango y precisión.
- Fiabilidad.
- Biocompatible.
- Mínimo consumo.
- Electrónica auxiliar reducida.
- Mínimo coste.



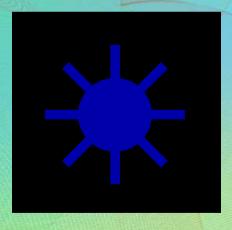
PCBMEMS

Caso Práctico

Caudalimetro. Principio físico:

- Presión diferencial.
- Tubo Pitot
- Efecto Doppler
- Transferencia de calor.
- Mecánico.

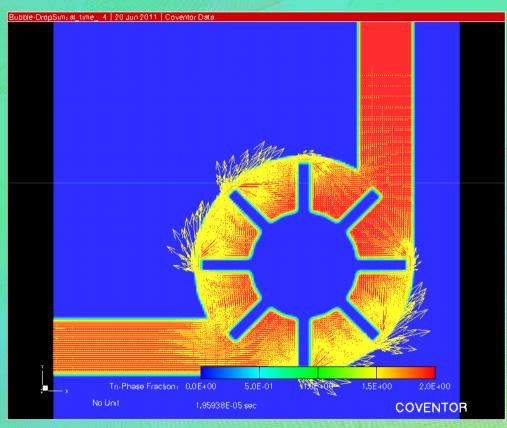




Caudalimetro. Modelado:

Caudal	Caudal	Altura	Anchura	Radio Medio	Número de	Sección	V lineal	Relación Vol	V lineal	V angular	V angular	Pulsos/s
	(m3/s)	canal (m)	canal (m)	Alabe (m)	Alabes	canal (m2)	canal (m/s)	rueda/canal	rueda (m/s)	rueda (rad/s)	rueda (rps)	(Hz)
1 nL/s	1,00E-12	2,00E-04	2,00E-03	3,00E-03	8	4,000E-07	2,500E-06	0,80	3,125E-06	1,042E-03	1,658E-04	1,326E-03
10 nL/s	1,00E-11	2,00E-04	2,00E-03	3,00E-03	8	4,000E-07	2,500E-05	0,80	3,125E-05	1,042E-02	1,658E-03	1,326E-02
100 nL/s	1,00E-10	2,00E-04	2,00E-03	3,00E-03	8	4,000E-07	2,500E-04	0,80	3,125E-04	1,042E-01	1,658E-02	1,326E-01
1 uL/s	1,00E-09	2,00E-04	2,00E-03	3,00E-03	8	4,000E-07	2,500E-03	0,80	3,125E-03	1,042E+00	1,658E-01	1,326E+00
10 uL/s	1,00E-08	2,00E-04	2,00E-03	3,00E-03	8	4,000E-07	2,500E-02	0,80	3,125E-02	1,042E+01	1,658E+00	1,326E+01
100 uL/s	1,00E-07	2,00E-04	2,00E-03	3,00E-03	8	4,000E-07	2,500E-01	0,80	3,125E-01	1,042E+02	1,658E+01	1,326E+02
1000 uL/s	1,00E-06	2,00E-04	2,00E-03	3,00E-03	8	4,000E-07	2,500E+00	0,80	3,125E+00	1,042E+03	1,658E+02	1,326E+03

Caudalimetro Simulación en Coventor:



Campo de velocidades





Caudalimetro. Run card (1):

Medidor de flujo por giro de rueda

Diseñado por: A. Luque

Modificado: 10 junio

Creado: 28 abril 2011

2011

Sustratos: PCB, Cu 35um 1 cara

Niveles: copper, wheel

1-3: CAPA SACRIFICIO

		The same of the sa	/=\(\)	100		
Paso	Descripción	Equipo	Parámetros	Objetivo	Actual	Observaciones
1	Sustratos					
1,1	Obtención		- A STATE OF THE S			
1,2	Corte	Sierra	A	7x7cm2	-	
2	Fotolitografía PCB					
2,1	Limpieza	18 70	/ S			100
2,2	Exposición UV	Insoladora tubos	2min30s, máscara copper			X
2,3	Revelado	Banco húmedo	<4 min			
2,4	Limpieza	Banco húmedo	Agua corriente			
3	Grabado cobre					-k
3,1	Grabado Cu	Banco húmedo	1:1:2 H2ClO3:H2O2:H2O, 3 min			
3,2	Limpieza	Banco húmedo	Agua corriente			
3,3	Eliminación fotorresina	Banco húmedo	Acetona			

Caudalímetro. Run card (2):

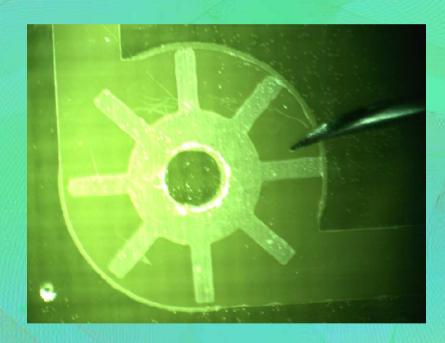
4-6:	RUEDA Y CANAL								
4	Deposición SU8								
4,1	Spin coating SU8	Spin coater	700 rpm, 1 min	100um					
4,2	Soft bake	Hot plate	2min 65°C, 45min 90°C						
4,1	Spin coating SU8	Spin coater	700 rpm, 1 min	200um total					
4,2	Soft bake	Hot plate	2min 65°C, 60min 90°C	200					
5	Fotolitografía SU8								
5,1	Exposición UV	Alineadora SMA	30s, máscara wheel , alineación misma cara		200				
5,2	Post Exposure Bake	Hot plate	2min 65°C, 9min 90°C						
6	Revelado SU8								
6,1	Revelado	Banco húmedo	Developer, 7min		100				
6,2	Limpieza	Banco húmedo	IPA						
6,3	Inspección								

Caudalímetro. Run card (3):

7-9: LIBERACIÓN RUEDA Y TAPADERA

7	Grabado Cu				
7,1	Grabado Cu	Banco húmedo	1:1 H2ClO3:H2O2, 1 min		
7,2	Limpieza	Banco húmedo	Agua corriente		
7,3	Inspección				
8	Tapadera				
8,1	Corte	Sierra	Metacrilato	30x30x4mm3	
8,2	Limpieza		IPA		
8,3	Pegado		Cinta Scotch doble cara		
8,4	Inspección				
9	Orificios entrada y salida				
9,1	Mecanizado	Taladro		Ø 1mm	
9,2	Limpieza		IPA		
9,3	Pegado		Tubo, epoxi rápida	ø 3mm	

Caudalimetro Fabricación:

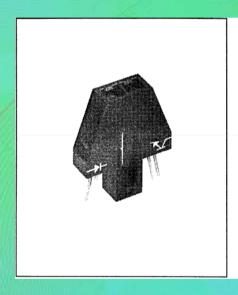


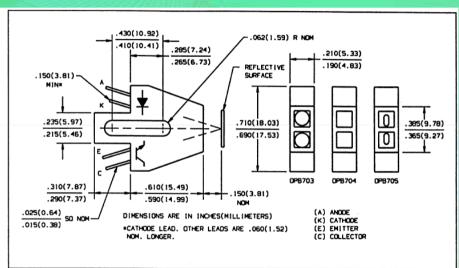
Sin tapadera



Con tapadera

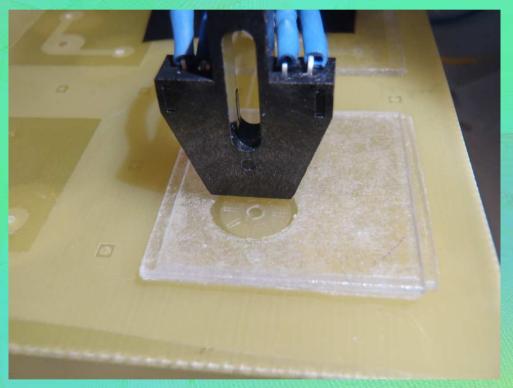
Caudalimetro Caracterización:





Electrónica auxiliar: Optoacoplador OPTEK OPB703.

Caudalimetro Caracterización:



Montaje optoacoplador

Caudalimetro Caracterización:

PERO EL DISEÑO ACTUAL NO FUNCIONA

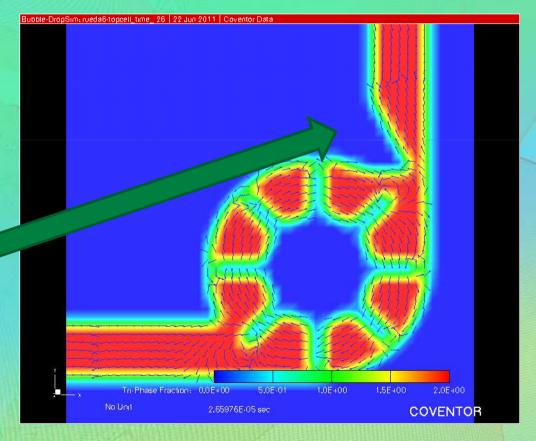
¿Por qué? Simetría del campo de presiones.

Ecuación de Bernouilli:

$$\frac{\rho v^2}{2} + P + \rho gz = cte.$$

Solución:

Modificar el campo de velocidades de entrada.



Caudalimetro Caracterización:

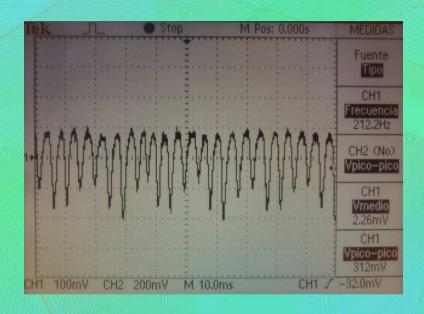


Comportamiento con aire

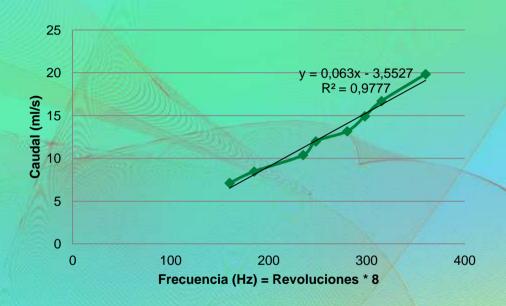


Comportamiento con agua

Caudalimetro. Caracterización (aire):



Pulsos generados por los álabes



Característica Frecuencia/Caudal

Indice

- Motivación.
- Comportamiento de los fluidos a microescala.
- Ejemplos:
 - Lab-on-Chip.
 - Nebulizador.
- Proceso de fabricación.
- Caso práctico: caudalímetro.
- Resumen.

Resumen

Conclusiones

- •Tecnología en desarrollo con un futuro prometedor.
- Campos de aplicación diverso (análisis, reactores, nebulización...)
- Aplicación en análisis químico y biológico con fuerte valor añadido.

Futuros desarrollos:

- Nanotecnología.
- Aplicaciones biólógicas y médicas.
- Nuevas aplicaciones.
- Integración (interfaces, modularidad, 3D)
- Estandarización

Bibliografía

- G. M. Whitesides. What Comes Next?. Lab on a Chip. Pag. 191–193. 2011.
- Y. C. Lim A. Z. Kouzani W. Duan, Lab-on-a-chip: a component view, Microsyst Technol Pag. 1995–2015. 2010.
- P Abgrall and A-M Gué. Lab-on-chip technologies: making a microfluidic network and coupling it into a complete microsystem. J. Micromech. Microeng. pag. R15–R49, 2007
- C. Aracil, F. Perdigones, J. M. Moreno, J. M. Quero. **BETTS: Bonding, exposing and transferring technique in SU-8 for microsystems fabrication.** J. Micromech. Microeng. Pag.1-7. 2010

Esta presentación:

ftp resa21.us.es

username: IBERNAM

fichero: Microfluidica.pdf

Password: CursoTarragona